(19)日本图特許广(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出銀公開登号 特開2001-84631 (P2001-84631A)

(43)公開日 平成13年3月30日(2001.3.30)

(51) Int.CL7
G11B 7/135

織別記号

FI G11B 7/135 ラーマコード(参考)

A 5D119

審査請求 京請求 請求項の数6 OL (全 II 頁)

(21)出願番号

特顯平11-256272

(71)出頭人 000000044

旭硝子株式会社

(22)出題日

平成11年9月9日(1999.9.9)

京京都千代田区有梁町一丁目12卷1号

(72) 発明者 野村 联治

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地

旭硝子株式会社内

(72) 発明者 村田 浩一

神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1150番地

**亚硝子株式会社内** 

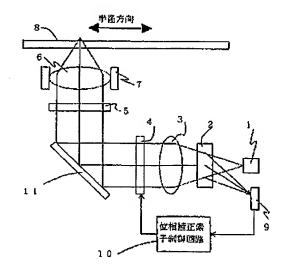
Fターム(参考) 50119 AA03 AA41 BA01 CA16 EC13

GA02 JA31 JA61 KA43 NA05

# (54) 【発明の名称】 光ヘッド装置

# (57)【要約】

【課題】光へッド装置に設置されている、位相補正素子を駆動する電源数を低減して装置全体の小型化を図る。 【解決手段】それぞれ透明な導電性薄膜を形成した一対の基板に挟持された異方性光学媒質を備え、2つの導電性薄膜の一方または両方の導電性薄膜の一部が線状化されて線状抵抗が形成されている位相補正素子4を、半導体レーザ1と対物レンズ6との間に設置した光へッド装置とする。



## 【特許請求の範囲】

【語求項1】光源と、光源からの出射光を光記録媒体上に景光させるための対物レンズと、光源と対物レンズとの間に設置されて出射光の波面を変化させて光記録媒体上における波面収差を結正する位相補正素子と、位相結正素子に波面を変化させるための電圧を供給する制御電圧発生器とを備えた光へッド装置であって、位相補正素子はそれぞれ返明な導電性薄膜を形成した一対の返明な基板に挟持された具方性光学媒質を備え、2つの導電性薄膜の一方または両方の導電性薄膜の一部が複状化され 10 て線状抵抗とされていることを特徴とする光へッド装置

【語求項2】前記2つの導電性薄膜のそれぞれの一部が前記線状抵抗とされ、前記線状抵抗が形成された導電性薄膜のそれぞれの残りの部分に、異方性光学模質の異なる位置に異なる電圧が供給できるように複数の電圧供給手段が備えられている請求項1に記載の光へッド装置。【語求項3】前記制御電圧発生器が発生する電圧の波形が矩形状であり、矩形の山と谷の時間幅が等しく、かつ対向する基板間のそれぞれの電圧供給手段に供給される20ぞれぞれの電圧の時間平均が等しい語求項2に記載の光へッド装置。

【語求項4】光源と、光源からの出射光を光記録媒体上に景光させるための対物レンズと、光源と対物レンズとの間に設置されて出射光の波面を変化させて光記録媒体上における波面収差を補正する位相補正素子と、位相補正素子に波面を変化させるための電圧を供給する副御電圧発生器とを備えた光へット装置であって、

位相補正素子はそれぞれ透明な導管性障膜を形成した一 対の透明な基板に挟持された異方性光学媒質を備え、2 30 つの導管性薄膜は異方性光学媒質の異なる位置に異なる 管圧が供給できるよう複数の管圧供給手段を備え。

前記制御宮圧発生器が発生する宮圧の波形が矩形状であり、矩形の山と谷の時間幅が等しく、かつそれぞれの宮 圧供給手段に供給されるそれぞれの宮圧の時間平均が等 しいことを特徴とする光へッド装置。

【請求項5】前記制御客圧発生器が発生する電圧の波形が、2つの導電性薄膜間で位相が合っているか、または180度異なっている請求項1から4までのいずれかに記載の光ヘッド装置。

【請求項6】前記導電性薄膜のシート抵抗が50Ω/□ 以上である請求項1から5までのいずれかに記載の光へ ッド装置。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスクなどの 光記録媒体の信報の記録・再生を行う光へッド装置に関 する。

[0002]

【従来の技術】光ディスクであるDVDは、同じく光デ 50 なる位相変化を発生させる必要がある。例えば、光ディ

ィスクであるCDに比べディジタル情報が高密度で記録されており、DVDを再生するための光へッド装置は、光源の波長をCDの780nmよりも短い650nmまたは635nmとしたり、対物レンズの関口数(NA)をCDの0.45よりも大きい0.6にして光ディスク上に最光するスポット径を小さくしている。

【0003】さらに、次世代の光記録においては光瀬の 波長を400nm程度、NAを0.6以上とすることで、より大きな記録密度を得ることが提案されている。しかし、光瀬の短波長化や対物レンズの高NA化が原因で、光ディスク面が光軸に対して直角より傾くテルトの許容量や光ディスクの厚みムラの許容量が小さくなる。【0004】これら許容量が減少する理由は、光ディスクのテルトの場合にはコマ収差が発生し、光ディスクの厚みムラの場合には対面収差が発生するために、光ベッド装置の集光特性が劣化して信号の読み取りが困難になることである。高密度記録において、光ディスクのチルトや厚みムラに対する光ペッド装置の許容量を並げるためにいくつかの方式が提案されている。

【00005】一つの方式として、通常光ディスクの半径方向(トラッキング方向)と光軸方向(フォーカス方向)との2軸方向に移動する対物レンズのアクチェエータに、検出されたチルト角に応じて対物レンズを傾けるように傾斜用の軸を追加する方式がある。しかし、この追加方式では球面収差は補正できないことや、アクチュエータの標準が複雑になる問題がある。

【0006】また別の方式として、対物レンズと光源との間に備えた位相補正素子により波面収差を補正するものがある。この補正方式では、アクチュエータに大幅な改造を施すことなく光へッド装置に素子を組み入れるだけでチルトの許容量や光ディスク厚みムラの許容量を拡けることができる。

【0007】例えば、位相補正素子を用いて光ディスクのテルトを結正する上記の補正方式に特関平10-20263がある。これは、位相消正素子を構成している液晶などの復屈新性材料を挟持している一対の基板のそれでれた、電極が分割されて形成された分割電極に電圧を供給して、復屈折性材料の実質的な屈折率を光ディスクのチルト角に応じて変化させ、この屈折率の変化により発生した透過光の位相(液面)変化により、光ディスクのチルトで発生したコマ収差を結正する方式である。【0008】

【発明が解決しようとする課題】前途した位相補正素子には、透過光の位相(液面)変化を発生させるために、 異方性光学模質である復屈折性材料に電圧を印加する分 割電値を複数個形成する必要がある。また、この分割電 極間には異なった弯圧を供給する必要があり、分割電極 の数に対応した供給電圧が必要であった。

【①①①9】また、緯正したい収差の成分によって、冥かる位相が化る発生させる以前がある。 解さば、まず、

スクの傾斜によるコマ収差のみでも、光ディスクの半径 方向と接根方向の2種類の成分があり、実際の光ディス クではこれらの直交する2種類の成分の合成で収差が発 生する。この2種類の収差の成分を補正するための分割

3

電極のバターンは、分割数が非常に多くなり、配線と制 御が非常に複雑になる。 【0010】また、分割数を少なくしてバターンを簡素 化すると十分な収差舗正機能が得られない。この対策と

して、2 種類以上の別の収差成分を補正する位相補正素 子を2個以上張り合わせることが考えられる。この場合 10 特性は良いものが得られるが、2つの位相補正素子を合 わせる工程が必要となり生産性がよくない。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の課題を 解決するためになされたものであり、 光瀬と、光纜から の出射光を光記録媒体上に集光させるための対物レンズ と、光源と対物レンズとの間に設置されて出射光の波面 を変化させて光記録媒体上における波面収差を補正する 位相補正素子と、位相補正素子に波面を変化させるため の電圧を供給する制御電圧発生器とを備えた光へッド装 20 置であって、位祖翁正素子はそれぞれ透明な導電性薄膜 を形成した一対の透明な基板に挟持された異方性光学媒 質を備え、2つの導電性薄膜の一方または両方の導電性 薄膜の一部が線状化されて線状抵抗とされていることを 特徴とする光ヘッド装置を提供する。

【0012】また、前記2つの導電性薄膜のそれぞれの 一部が前記線状抵抗とされ、前記線状抵抗が形成された 導電性薄膜のそれぞれの残りの部分に、異方性光学媒質 の異なる位置に異なる電圧が供給できるように複数の電 圧供給手段が構えられている上記の光ヘッド装置を提供 30 取ることができる。 する。また、前記制御電圧発生器が発生する電圧の波形 が矩形状であり、矩形の山と谷の時間帽が等しく、かつ 対向する基板間のそれぞれの電圧供給手段に供給される それぞれの弯圧の時間平均が等しい上記の光へッド装置 を提供する。

【10013】また、光源と、光源からの出射光を光記録 媒体上に集光させるための対物レンズと、光源と対物レ ンズとの間に設置されて出射光の波面を変化させて光記 録媒体上における波面収差を結正する位相結正素子と、 制御電圧発生器とを備えた光へッド装置であって、位相 結正素子はそれぞれ透明な導電性薄膜を形成した一対の 透明な基板に挟持された異方性光学媒質を備え、2つの 導電性薄膜は異方性光学媒質の異なる位置に異なる電圧 が供給できるよう複数の電圧供給手段を備え、前記制御 弯圧発生器が発生する弯圧の波形が矩形状であり、矩形 の山と谷の時間帽が等しく、かつそれぞれの電圧供給手 段に供給されるそれぞれの電圧の時間平均が等しいこと を特徴とする光ヘッド装置を提供する。

の波形が、2つの導電性薄膜間で位相が合っているか、 または180度異なっている上記の光ヘット装置を提供 する。さらに、前記導管性薄膜のシート抵抗が500/ □以上である上記の光へッド装置を提供する。

#### [0015]

【発明の実施の形態】本発明における位相領正素子は、 光記録媒体面上における波面収差であるコマ収差。球面 収差、非点収差の結正を少ない数の副御湾圧発生器で行 うことができる。以下では、コマ収差の領正、特に光デ ィスクの半径方向と接線方向の2種類のコマ収差の成分 の補正を行う場合について説明する。

【0016】図1に示した光ヘッド装置は、CDまたは DVDなどの光ディスク8に記録された情報を再生する ためのものであり、光源である例えば半導体レーザ1か ら出射した光は倒えばホログラムタイプの偏光ビームス プリッタ2を透過した後、コリメートレンズ3により平 行光となり、位相浦正案子4を透過後、立ち上げミラー 11で90°方向に反射され、4分の1波長板5を透過 し、アクチュエータ7に設置された対物レンズ6により 光ディスク8上に集光される。ここで、位相領正素子4 を構成している一対の基板はともに透明である。

【0017】 集光された光は光ディスク8により反射さ れ対物レンズ6、4分の1波長板5、立ち上げミラー1 1. 位相稿正素子4、コリメートレンズ3を順次先程と は逆に透過した後、偏光ビームスプリッタ2により回折 され光検出器9に入射する。前述の半導体レーザ1から の出射光が光ディスク8により反射される際、光ディス クの面上に記録された情報により反射光は振幅変調さ れ、光検出器9により光強度信号として記録情報を読み

【0018】図1では、立ち上げミラー11を使用し、 半導体レーザ1より出射した光の光路を変更したが、立 ち上げミラー11を使用せずはじめから半導体レーザ1 からの出射光の方向を光ディスク8の面に垂直となるよ うにしてもよい。本発明で用いる異方性光学媒質には、 ニオブ酸リチウムなどの光学結晶や液晶などが使用でき る。異方性光学媒質として液晶を用いることは、例えば 6 V程度の低い電圧によって実質的な屈折率が容易にか つ電圧の大きさに応じて連続的に制御できて好ましい。 位祖補正素子に波面を変化させるための電圧を供給する 40 さらに、ニオブ酸リチウムなどの光学結晶などと比べて 置産性が高く好ましい。したがって以下では、異方性光 学媒質として液晶の材料を使用する場合を説明する。

> 【①①19】使用する液晶材料は、ディスプレイ用途な どに用いられるネマティック液晶がよく、カイラル剤の **添加によりツイストさせてもよい。また、使用する基板** の材料としては、ガラス、アクリル系樹脂、エポキシ系 樹脂などが使用できるが、耐久性などの点からガラスの 基板が好ましい。したがって、以下では、基板の材料と して、ガラスを使用する場合を説明する。

【0014】また、前記副御電圧発生器が発生する電圧 50 【0020】図2は本発明における位組領正案子の一例

を示す断面図である。ガラス基板21a、21bが、例 えばエポキシを主成分とするシール村22により接着さ れ液晶セルを形成している。シール村22には例えばガ ラス製のスペーサと例えば樹脂の表面に金などを接膜し た導電性スペーサが含有されている。ガラス基板21a の液晶セルの内側表面には、内側表面から弯極24 a、 シリカなどを主成分とする絶縁膜25 a および配向膜2 6 aがこの順で被膜されており、またガラス基板2 1 b の液晶セルの内側表面にも、同様に電極24 b. シリカ などを主成分とする絶縁膜25万および配向膜26万が この順で彼順されている。また液晶セルの外側表面には 反射防止膜が被膜されていてもよい。

【りり21】本発明では電極とは、透明な導電性薄膜よ り形成されるものをいう。電極24aは電極引出部27 で接続線によって位相領正素子制御回路と接続できるよ うパターン配線されている。また電極2.4 b は前途の導 電性スペーサによりガラス基板21a上に形成された電 極248と電気的に接続されており、したがって、弯極 引出部27で接続線によって位相浦正素子制御回路と接 続できる。液晶セル内部には液晶23が充填されてお り、図2に示した液晶分子28は、一方向に配向された ホモジニアス配向の状態にある。電便24g、24りの 材質は両基板を透明としているために、透過率が高い方 が望ましく、ITOなどの透明導電膜を使用すればよ

【0022】図3は、本発明におけるコマ収差補正用の 位組補正案子のセグメントのパターンの一例を示す図で あり、(1)は一方の基板用の模式的平面で、(2)は 他方の基板用の模式的平面である。まず、一方の基板の 膜にはセグメントを形成しない場合を説明する。 図2の 例えば電極248をフォトリングラフィー技術などを用 いて図3(1)の5つの分割電極である5つのセグメン トに分割する。それぞれのセグメント(101~105) に外部から、例えば別々の報圧を供給できるようにす る。このように、導電性薄膜を複数のセグメントに分割 して、異方性光学媒質の異なる位置に異なる電圧を供給 するための電圧供給手段を設けた。

【0023】とれば、電圧供給手段として導電性薄膜を 複数のセグメントに分割した例であるが、分割せずに比 40 較的抵抗の高い導電性薄膜に複数個の鉛電点(部)を設 けて電圧供給手段とするなどの方法もある。以下では、 複数個に分割した分割電極であるセグメントの場合につ いて説明する。

【0024】コマ収差の場合には、光学シミュレーショ ンの結果、各セグメントに供給する電圧が、以下のよう な関係を満たすとき、収差を領正する効果に優れるので

[0.025]  $V_{101} = V_{101}$ ,  $V_{102} = V_{103}$ ,  $V_{103}$  it  $_{10.1}$ と $V_{10.2}$ との間の弯圧である。特にここでは $V_{10.2}$  =  $_{50}$  【0.030】また、分割数を少なくして間素化すると十

(Viet+Vin)/2の場合について説明する。とこ で、V,,,~V,,,はそれぞれセグメント101から10 5まで供給する電圧を示す。セグメントに電圧を供給す る場合、導弯性薄膜の一部が線状化された線状態抗が形 成されてこの線状抵抗に繋げられた電圧幾子に電圧が供 給される。セグメントが形成されていない導電性薄膜は 共通電極となっている。

【0026】図4は、本発明におけるコマ収差補正用の 位相補正素子のセグメントのパターンと線状抵抗を含む 配線図の一例を示す図であり、(1)は一方の基板用の 模式的平面図で、(2)は他方の基板用の模式的平面で ある。図4(1)に示すように配線し線状抵抗を用いる と、抵抗の弯圧降下により所望の中間電圧を作成するこ とができこの中間弯圧V。。。をセグメントに供給すると とができ、必要とする発生電圧は3つではなく。 Viei, Viei020である。

【0027】とこで、図示した抵抗は、位相制御素子の 外部に取り付けてもよいが、外部に抵抗を用いた場合に は、位相制御素子からの取りだし複数の増加と外部に抵 20 抗を実装することによる作業工程数の増加となる。これ に対し、位相調御素子内部の基板に稼状抵抗として内蔵 する方が部品点数を減らすことができる。この抵抗は、 !TOなどの遠明な導電性薄膜をパターニングするなど して作成でき、しかもこのパターニングは、この導電性 薄膜を分割する工程と同時に行うことができるので作成 の工程数を減らすことができる。

【0028】このときの薄膜の抵抗値は100Ω以上が 好ましい。さらに位相制御素子の消費電力を下げるため には10k臭以上がより好ましい。これろの10k臭程 衛性藤順のみにセグメントを形成し、他の基板の電性薄 30 度の抵抗を作成する場合、適明な導電性薄膜のシート抵 抗が低いと細く長い線を作成する必要があり、長くする ことで線状抵抗が基板内にしめる面積が増えることや、 細くすることで作成時の断線による歩留まり低下が生じ やすい。このため、透明な導電性薄膜のシート抵抗は5 0Ω/口以上が好ましく。さらには200Ω/口以上が 好ましい。例えば300Ω/□の!TO膜(15nm 厚)を用いた場合10 k Ωの線状抵抗は、幅が30μm で長さがlmmの細線をITO膜にバターニングして作 成できる。このとき線状抵抗は直線状の抵抗を複数回数 折り曲げる形状として作成してもよい。ここで、シート 抵抗の単位♀ノ□は、正方形の薄膜が有する抵抗を意味 する.

> 【0029】光ディスクの傾斜によるコマ収差の場合。 円形の光ディスクの半径方向と接線方向の2 種類のコマ 収差の成分があり、実際の光ディスクではこれらの直交 する2種類の成分の合成で収差が発生する。この2種類 の収差成分を補正するためのセグメントのパターンは、 一般に分割数が非常に多くなり、配線と制御が極めて複 維になる。

分な収差箱正機能が得られない。このため、2種類以上 の異なるコマ収差成分を補正する位相補正素子を2個以 上張り合わせることが考えられる。張り合わせる場合。 特性はよいものが得られるが2つ以上の位相領正素子が 必要となり生産工程数が増加する。

【0031】本発明では一対の基板にそれぞれの複数個 のセグメントを形成してコマ収差の成分を結正する。し たがって次に、両方の基板の電性薄膜にセグメントを形 成する場合を説明する。このときのセグメントのバター 2の電極24aと電極24bをそれぞれフォトリソグラ フィー技術などを用いて図3(1)と図3(2)のパタ ーンでそれぞれ5つのセグメントに分割する。そしてそ れぞれのセグメント、すなわち電極24gのセグメント (101~105)、電極24bのセグメント (201 ~205)に外部から例えば別々の電圧を供給できるよ うにする。

【りり32】とのコマ収差補正の場合には、光学シミュ レーションの結果、各セグメントに供給する電圧が、以 下のような関係を満たすとき、収差を補正する効果に優 20 れるので好ましい。

 $V_{101} = V_{101}$ ,  $V_{102} = V_{101}$ ,  $V_{103} = (V_{103} + V_{103})$  $V_{102}$ ) /2,  $V_{201} = V_{204}$ ,  $V_{202} = V_{205}$ .  $V_{203} =$  $(V_{201} + V_{202}) / 2.$ 

[0033] CCT, Viei~Viei, Vii,~Vioite れぞれセグメント101から105まで、201から2 0.5までに供給する電圧を示す。このとき図4に示すよ うにジグザグ状で龈状化された龈状抵抗を用いると、必 要となる配線数はV.o.、V.ez、V.ex、V.ex用の4本 となる。この図4で示した抵抗は、位相領正素子の外部 30 に取り付けてもよいが、前途のように素子内部に線状抵 抗として内蔵する方が部品点数を減らすことができて好 ましい。さらにこの抵抗は、それぞれの基板内に作成す ることで抵抗を作成するスペースが、各基板に配分さ れ、各基板を小さくできるので好ましい。

【①034】次にこの位組補正素子の駆動方法について 説明する。4つのセグメントに入力するそれぞれの電圧 V.e., V.e., V.e. V.e., O波形は矩形状で、山と谷 すなわち高電圧時と低電圧時の時間幅が等しい変調電圧 ト間(筐圧間)で概ね等しいことが好ましい。

【0035】との理由は、液晶はほぼ絶縁体であるが、 長時間一定の向きの電圧が印加されると電気分解するな として信頼性が劣化する。このことは、交流(矩形波) 電圧であり向きの異なる電圧であっても、山の高さと谷 の深さが異なって (振幅が異なって) いれば交流電圧に 直流成分、すなわち時間的に不変の電圧部分、を含むこ ととなりわずかであるが信頼性が劣化する。

【0036】直流成分をなくす駆動方法は、両墓板上の

転し(交流とし)、さらに各電圧の時間平均を等しくす ることである。また、交流の波形としては矩形が好まし い。さらに、対向する基板上の弯径(セグメント)間に 供給する電圧は、位相差がないか、または位相が180 度異なるものが望ましい。 この2つの電圧の位相が18 0度異なる場合の弯圧の波形例を図6に示した。この図 6中、セグメント101に供給した電圧の時間変化(図 6(1))とセグメント201に供給した電圧の時間変 化(図6(2))を示した。さらに、この2つの電圧の ンして上述のように図3(1)と図3(2)があり、図 10 時間変化の差を図6(3)に示した。この電圧の差が図 5に示したセグメント101と201との重なりの部分 に供給される電圧の差となり、実効的に液晶を駆動する 湾圧となる。この湾圧の絶対値は時間とともに振動せず 一定の値を得ることができ、液晶を透過する光の位相差 も変動しない。

> 【0037】しかし、2つの電圧に位相差があり、それ が180度でない場合には、2つの電圧の差は時間とと もに振動することになり、絶対値は一定とならない。一 般に表示素子として用いられる液晶素子の場合には、こ のように時間とともに振動する駆動方法が多く用いられ る。この2つの電圧間で位钼をずらせることで、2つの 宮圧の位相差に基づく実効的な電圧(電圧のRMS値) が変化しこれを応用して表示の階調操作などを行う。こ のとき、上述のように電圧差の絶対値も周期的に変化し ているが、人間の目には残像としてその平均値だけが感 じられるため問題はない。

> 【0038】一方、光ヘッド装置に用いる場合には、周 波数が極めて高くない限り、この電圧差の絶対値の時間 変化により位相補正素子内の液晶分子が応答すると、必 要とする光の位相差が時間とともに変化し、光ディスク の再生信号に重畳して再生信号のノイズとなり好ましく ない。このため、光ヘッド装置に用いる場合には、電圧 差の絶対値が時間とともに振動しないように、前述のよ うに2つの弯圧の位相差の条件と絶対値の条件を満たす 駆動方法が好ましい。また、対向する基板上の電極に供 給する電圧の位相差を180度とした方が、位相補正素 子への供給電圧を小さくできてさらに好ましい。

【0039】対向する基板上に、弯圧供給手段として異 なる種類の収差補正用のセグメントを形成した場合につ であり、さらに電圧の時間平均が、供給する各セグメン 40 いて詳しく説明する。前途のように図3では、互いに直 交する2種類のコマ収差補正用のセグメントを対向させ て液晶セルとした。このとき光ディスクの半径方向のコ マ収差置と接線方向のコマ収差置を独立に制御できるこ とが好ましい。本発明の光ヘッド装置における駆動方式 を用いれば独立に制御できる。さらに、緑状抵抗を用い ることで素子外への取り出し電極数が減らせるので好ま LILS.

【0040】供給する電圧波形は図6に示したものであ り、またVieiとVieiの平均値がViei、VieiとViei **電飯(セグメント)に供給する電圧の符号を時間的に反 50 の平均値がVュ。。。となるように線状抵抗を設定した。表** 

1に半径方向および接根方向のそれぞれの光ディスクの 傾きに対する供給電圧の一例を示した。ここで、表1は 光ディスク領さと各電圧のV。(最大値) V。(最少 値) の関係を示している。 この表にしたがって説明す

【0041】セグメント101と201との重なった部 分でV、、、とV、、、の弯圧が液晶に印加される。つまり、 図6(1)の電圧をV,,,とし、図6(2)の電圧をV 161としたとき、101と201の重なり合った部分に は、図6(3)の電圧差(電圧)が発生する。例えば、 光ディスクの傾きが半径方向、接線方向とも()度の時に は、表1のように、V,,,,=3.25 V、V,,,,=1. 75 V,  $V_{\mu\nu\rho\tau} = 3.25 V$ ,  $V_{\nu\nu\rho\tau} = 1.75 V$  (V ,e,とV,e,の電圧の時間平均はともに2.5V)とす る。そのときの両基板間(電極間)の電圧差は、±1. 5 V となり電圧差の絶対値は1.5 V であって時間的に 変化しない。

【0042】次に、光ディスクの半径方向にのみ0.8 度の光ディスクの領きがある場合に、半径方向のコマ収 差を補正するためにセグメント201と202の間の第 20 接線方向の波面収差を独立に、しかも加算的に容易に領 圧を変化させる。例えば、Vnie1=Vnie2=3.25  $V. V_{\text{ties}} = V_{\text{ties}} = 1.75 V. V_{\text{sies}} = 4.73$  $V. V_{\text{mag}} = 3.25 V. V_{\text{mag}} = 0.27 V. V_{\text{mag}} *$ 

\*=1. 75 Vとする。

【0043】このとき、201のセグメントのところで は、両基板間(電極間)の電圧差は、2、98V(= 3. 25-0. 27=4. 73-1. 75, 2020セグメントのととろでは、2Vとなり、中間のセグメン ト203の部分には、透明電極で構成された線状抵抗の 電圧降下により、電圧がソシャとソシックの中間値(ソーお よびV、同士で〉となる。このように、両基板間(電極 間)の電圧をセグメントにより変えることができる。

16 【0044】また、さらに半径方向の光ディスクの傾き に加え接根方向にも光ディスクが傾いた場合には、V zex、Vzezは上記と同じ電圧を供給し、V,o,、V,ezの みを表1の値。すなわちV\*\*\*e1=4. 73V、V\*\*\*e2= 3. 25 V,  $V_{\text{Light}} = 0$ . 27,  $V_{\text{Light}} = 1$ . 75 V,  $V_{\mu\nu\rho} = 4.73V, V_{\mu\nu\rho} = 1.75V, V_{\mu\nu\rho} =$ 0. 27V、V<sub>L1e2</sub>=1. 75Vとすることで、両方向 の光ディスクの傾きに対処できた。半径・接線の両方向 の光ディスクの傾きに対応できる。したがって、表しに 示された驾圧を用いることで、光ディスクの半径方向と 正できる。

[0045]

【表1】

			0.8度	<b>ジ度</b>	-0.8度	
半孫方向光ディスク頃を	0.85% ]	V101	0. 27, 4, 73	1. 75. 3. 25	1. 75. 3. 25	
		V102	1.75.3.25	1. 75, 3, 25	0. 27. 4. 73	
		V201	0. 27. 4. 73	0. 27, 4. 73	0. 27. 4 73	
		V 2 U 2	1. 75. 9. 25	1. 75. 3. 25	1. 75, 3. 25	
	0度	V101	0. 27. 4. 73	1. 75, 3. 25	1. 75. 3. 25	
		V 1 0 2	1. 75. 3. 25	1. 75. 3. 25	0. 27, 4. 73	
		V201	1. 75. 3. 25	1. 75. 3. 25	1. 75. 3. 25	
		A505	1. 75. 3. 25	1. 75, 3. 25	1. 75. 3. 26	
	-0. 8 <i>8</i> 5	V101	6. 27. 4. 73	1. 75. 3. 25	1. 75. 8. 25	
		V102	1. 75. 3. 25	1. 75. 3. 25	6 27. 4. 73	
		V201	1. 75. 3. 26	1. 75. 3. 25	1. 75. 3. 25	
		V 2 0 2	0. 27, 4. 73	0. 27. 4. 73	0, 27, 4, 73	

【0046】図3に示したセグメントのパターンは主に コマ収差を領正するためのものであり、例えば光ディス クがチルトした場合でも、位相補正素子に適切な電圧を 供給することにより良好な光ディスクからの再生信号を 得ることができる。また、セグメントのパターンを図7 のようにすることで、球面収差や非点収差を領正でき

【10047】図7(1)は主に球面収差を絹正する場合

る。この場合、光ディスクの厚みが変化しても、位相浦 正素子に適切な電圧を供給することにより良好な再生信 号を得ることができる。図7(2)は主に非点収差を消 正する場合のセグメントのバターンの一例を示す模式的 平面図である。この場合、半導体レーザ自体や他の光学 部品により発生する非点収差を領正できるため光ディス クからの良好な再生信号を得ることができる。

【0048】上記のように、 領正する波面収差に応じた のセグメントのパターンの一例を示す模式的平面図であ 50 セグメントのパターンを形成して、セグメント間にギャ

ップを設けることがセグメント間の絶縁性の点から好ま しいが、広すぎると光の遠過率が低下する。ギャッフを 7μm以下にすることにより、実質的に透過率が高い位 相補正素子を得ることができる。

#### [0049]

【実施例】本実施例では図1に示す光ヘッド装置により 光ディスク8に記録された情報を再生する。光ヘッド装 置には図2に示す構成の位相簿正素子4が組み込まれて おり、光ディスクがチルトしていたので、光検出器9で ィスク8の半径方向のチルト畳に応じた電圧を発生さ せ、位相緒正素子4を駆動させた。

【0050】位钼綿正素子4は、厚み0.5mmの無ア ルカリ性のガラス基板21a、21bとエポキシを主成 分とするシール村22により構成される液晶セル構造を 有しており、シール材22に含有されたガラス製のスペ ーサにより液晶セルの間隔が4.6μmとなっている。 液晶セルの内部には鴬光屈折率と真常光屈折率の差が 0.2のネマティック液晶が充填されており、ガラス基 板21a、21bの表面に施されたポリイミドの配向膜 20 26a、26bにより図2に示す紙面左右方向に液晶分 子28が配向している。

【0051】また、配向膜26a、26bとガラス基板 の間には絶縁膜25a、25b、ITOのセグメントか ちなる電極24a、24bが形成されており、電極24 a. 24 b は電極引出部27において位相簿正素子制御 回路 1 () と接続されている。 弩極 2 4 a は図 3 (1) の ように光ディスクの接線方向の傾斜に基づくコマ収差を 縞正するセグメントを形成し、さらに図4(1)のよう な線状抵抗をITOの透明な導電性薄膜をパターニング 30 することで作成した。

【0052】このとき用いた!TO膜のシート抵抗は3 (1)Ω/□であり、幅30μmで長さ1mmの折り曲げ られた抵抗線 (線状抵抗) とした。また、1つの導電性 薄膜の抵抗は約10kgであり台計2個の線状抵抗を直 列に接続した。この接続により、弯極端子101aと1 ①2bにのみ電圧を供給することで電極24aの全ての セグメントに電圧が供給できた。

【0053】また、弯極24bは図3(2)のよろに光 セグメントを形成し、さらに図4(2)のような像状抵 抗をITOの透明な導弯性薄膜をパターニングすること で作成した。このとき用いた「TOのシート抵抗は前述 の電極24 a と同様に300Q/口であり、幅30 μ m で長さlmmの折り曲げられた抵抗線とした。このとき 1つの銀状抵抗は約10kΩであり合計2個の線状抵抗 を直列に配置した。この設置で、電極端子101aと1 02bにのみ電圧を供給することで電極24bの全ての セグメントに電圧が供給できた。

【0054】また図2のように、この2枚の基板21a~50~方向のコマ収差を鎬正する電圧VュeュとVュeュを以下のよ

と21りを導電性ビーズを混合したシール材22で接合 し、シール材22が基板21aと21bとに接触する部 分のうち、上下墓板の対応する接触する部分に電気的接 触をとるための電極を作成した。この電極によりシール 材に混合した導電ビーズと通じて両差板21aと21b とを電気的に接続し、基板211のセグメント101~ 105にVュ。ュとVュ。ュの電圧を供給できる。これによ り、基板2 la上の電極引出部2 7部の透明電極側にフ レキシブル回路墓板を熱圧着することで、必要な位相繪 得た信号を位相補正素子副御回路10にて処理し、光デー16 正素子のセグメント101~105とセグメント201 ~205用の駆動電圧Viei、Viei、Viii、Viiiを供 給できた。

> 【0055】位組箔正案子のこれらのセグメントを含む 最外層円の直径は4mmであり、対物レンズに入射する 光はこのセグメントを含む円内を透過する際に、セグメ ント101~105まで、およびセグメント201~2 05の各々に供給された電圧値に応じた位相シフトを光 のそれぞれの領域で受けた。

【10056】次に、供給する電圧について説明する。本 実能例では、液晶セルの対向する基板間(電極間)に供 給する穹圧が1.5 Vから3.5 Vまでの間で、光の位 相が概ね電圧に対して直線的に変化する電圧を液晶セル に印加することで透過光の位相差を発生できた。

【0057】位組領正案子の駆動電圧波形は、図6に示 した波形であった。電圧VュュュはVュュ,とVュュ」との平均 値、電圧Vュ。」はVュ。」とVュ。」との平均値となるように 被状紙抗を設定した。また、電圧の波形は矩形状で山と 谷の時間幅が等しく、電便248のセグメント101~ 105に供給する電圧V。。。およびV。。。と、電極24b のセグメント201~205に供給する電圧V201およ びりょ。」との位相を180度ずらせた。また、電圧 V<sub>101</sub>、V<sub>101</sub>、V<sub>101</sub>、V<sub>101</sub>の時間平均は2.5 Vで同 じ値にすることで、位相補正素子の液晶に印加される電 圧の直流成分をなくした。

【① 058】表1に基づいて、本実施例をさらに説明す る。セグメント101と201の重なった部分に電圧V \*\*\*とソ\*\*\*との電圧差が液晶に印加される。つまり、図 6 (1) の電圧をV.o.とし、図6(2)の電圧をV.e. としたとき、セグメント101と201の重なり合った ディスクの半径方法の傾斜に基づくコマ収差を補正する 40 部分には、V,。,とV,。,との差である図6 (3)の電圧 差が発生する。例えば、光ディスクの傾きが半径方向・ 接線方向ともにないときには、表1のように、Vane1= 3. 25 V,  $V_{\text{trei}} = 1$ . 75 V,  $V_{\text{diei}} = 3$ . 25V. V.ze. = 1. 75 V (V.,, とV.,, の電圧の時間平 均はともに2. 5 V ) とする。このときの両基板間(電 極間)の電圧差は、±1.5 Vとなり電圧差の絶対値は 1. 57であり時間的に変化しない。

> 【0059】次に、光ディスクの半径方向にのみ0.8 度の光ディスクの領きがあるときの電圧としては、半径

うに設定した。 Vnici = Vnici = 3. 25 V、 Vlici =  $V_{1102} = 1.75V, V_{1101} = 4.73V, V_{1102} =$ 3. 25V,  $V_{1201} = 0$ . 27V,  $V_{1202} = 1$ . 75

【0060】このとき、セグメント201の位置には、 両墓板間(弯極間)の弯圧差は2.987(=3.25 -0.27=4.73-1.75), セグメント202 の位置には、電圧差は2 V となり、中間のセグメント2 0.3の位置には、透明な導電性薄膜で形成された線状抵 る。このように、電極間電圧差をセグメントに応じて変 えることができた。

【0061】また、さらに半径方向の光ディスクの領き に加え接線方向にも光ディスクが傾斜したときには、弯 圧V.。、V.。。は上記と同じ電圧とし、電圧V.。、V 1e2のみを表1の値、すなわちV#1e1=4. 73V、V  $v_{1102} = 3.25 \text{ V}, V_{1101} = 0.27, V_{1102} = 1.7$  $5 \text{ V. } V_{\text{m201}} = 4.73 \text{ V. } V_{\text{m202}} = 1.75 \text{ V. } V_{\text{s2}}$ e,=0.27V. V.co.=1.75Vとすることで、両 方向の光ディスクの傾きに対処できた。

【0062】したがって、表1に示された電圧を用いる ことで、光ディスクの半径方向と接線方向の波面収差を 独立に、しかも加算的に容易に結正できた。この位相領 正素子を用いることで半径・接線方向それぞれの傾斜を 持つ光ディスクに対して適切な電圧を選択することによ り、光ディスクの再生信号は良好となり再生信号のノイ ズとなるジッターを改善することができた。

## [0063]

【発明の効果】本発明の位相補正素子を装着した光ヘッ ド装置においては、位相補正素子の基板上の導電性薄膜 30 10:位相簿正素子制御回路 の一部を使用して線状抵抗を形成することにより、位相 **浦正素子駆動用の電源の敷を減らすことができ装置の小** 型化が図れる。また、導電性薄膜の複数の電圧供給手段 に供給する矩形状の電圧の山と谷の時間幅を等しくし、 かつ電圧の時間平均値をそれぞれ等しくすることによ り、光ディスクの再生信号にノイズのない良好な信号を 得ることができる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ヘッド装置の原理構成の一例を示す 概念的断面図。

【図2】本発明における位組稿正素子の一例を示す断面 図.

【図3】本発明におけるコマ収差用の位相循正素子の弯 極バターンの一例を示す図、(1)一方の基板用模式的 平面. (2)他方の基板用模式的平面。

【図4】本発明におけるコマ収差縮正用の位相補正素子 のセグメントのパターンと領状抵抗を含む配線図の一例 を示す図、(1)一方の蟇板用の模式的平面、(2)他 方の墓板用の模式的平面。

【図5】図3(1)、図3(2)の電極バターンの重な りの部分を示す平面図。

抗の電圧降下により、電圧がVュ。。とVュ。ュの平均値とな「10」【図6】2つの電圧の位相が180度異なる場合の電圧 の波形例を示す概念図、(1)一方のセグメント(10) 1) に供給した電圧の時間変化を示す概念図、(2)他 方のセグメント (201) に供給した電圧の時間変化を 示す概念図、(3)(1) および(2)の2つの電圧の 時間変化の差を示す概念図。

> 【図7】球面収差および非点収差を補正する場合のセグ メントのパターンを示す模式的平面図。(1)主に球面 収差の場合の一例の模式的平面図、(2)主に非点収差 の場合の一例の模式的平面図。

【符号の説明】

1:半導体レーザ

2: 偏光ビームスプリッタ

3: コリメートレンズ

4:位相消正素子

5:4分の1波長板

6:対物レンズ

7:アクチュエータ 8: 光ディスク

9:光検出器

11:立ち上げミラー

2 la、2 lb:ガラス茎板

22:シール村

23:液晶

24a、24b: 弯極

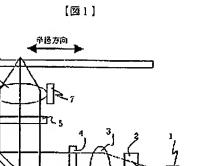
25. 42: 絶縁膜

26.43:配向膜

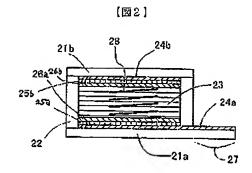
27: 萬極引出部

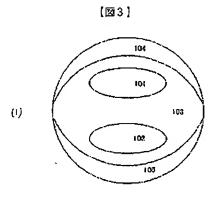
28.44:液晶分子

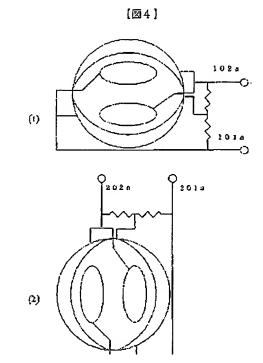
40 101、102、103、104、105:セグメント 201、202、203、204、205:セグメント 101a、102a、201a、202a:弯極端子

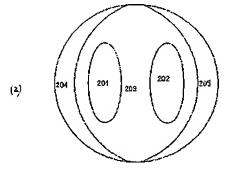


拉福拉正索 子制到回路

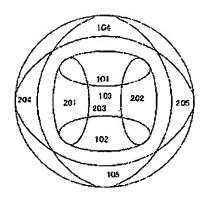




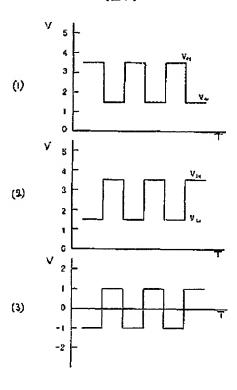




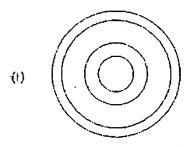
[図5]



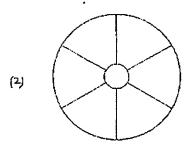
[図6]



[図7]



球面収差を補正する場合



非点収差を補正する場合